

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所 在 地 京都府向日市森本町東ノ口 1-1
ニデックパーク C 棟

「SEMICON Japan 2025」への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2025 年 12 月 17 日(水)～12 月 19 日(金)に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2025」に出展いたします。



今回の展示会では、「One Stop Solution」をテーマに、AI サーバーやパワー半導体向けの最新ソリューションを出展いたします。パネルレベルパッケージやベースボード製品に最適な、AI 技術を取り入れた AVI、2D/3D 光学検査装置をはじめ、IGBT/WBG デバイス等に使用される Wafer (KGD) /Module 向けの電気特性検査装置などを展示。また、熱対策を含む新たな検査ニーズに対応するプローブカード等、市場のトレンドに合わせた最先端の検査技術をご提案いたします。

〈出展概要〉

- ・会期：2025 年 12 月 17 日(水)～12 月 19 日(金)
- ・会場：東京ビッグサイト 東展示棟
- ・ブース：4Hall E4922
- ・公式サイト：<https://www.semiconjapan.org/jp/>

〈出展内容〉

- 光学式検査装置「RWi-300MK3」：2D+3D 検査に AI 技術を駆使
- パワー半導体向け検査装置「NATS Series」：IGBT/WBG デバイスに対応
- 高電圧対応加圧構造プローブカード：放電対策を応用
- デバイス温度測定プローブ：熱電対技術を適用
- 2D-MEMS プローブカード：2D-MEMS 技術を適用し、CMOS イメージセンサーに対応
- 垂直型狭ピッチ対応プローブカード：高精度なメッキ技術で挟ピッチ 55μm に対応
- プローブ「NS Probe」：MEMS プロセスを用いて微細化と特殊な形状を実現
- 自動搬送機「EFEM」：ファクトリーオートメーション対応
- 通電検査装置「GATS-8360A」：AI・LEO 衛星基板向け
- 通電検査装置「GATS-7885」：PLP/Interposer 向け